增刊

X射线驻波方法研究半导体超薄异质外延层

姜晓明,贾全杰,胡天斗,黄字营,郑文莉,何伟,冼鼎昌,施斌1,蒋最敏1,王迅1

(中国科学院高能物理研究所 北京 100039)

(1 复旦大学应用表面物理国家重点实验室 上海 200433)

收稿日期 2000-5-26 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 利用双晶单色器和精密二圆衍射仪,在北京同步辐射装置建立了同步辐射X射线驻波实验技术,并用这一实验<mark>▶加入我的书架</mark> 技术结合X射线衍射方法,研究了Si晶体中外延生长的超薄Ge原子层的微结构.实验结果表明,由于Ge原子的偏析, 在Si晶体样品中形成了共格生长的Ge<sub>v</sub>Si<sub>1-v</sub>合金层,浓度平均值为x≈0.13;650℃退火会使Ge原子向表面扩 散,Si晶体中的合金层消失,在晶体表面形成接近纯Ge的单原子层.

关键词 X射线驻波 异质结构 偏析 原子占位

分类号

DOI:

通讯作者:

姜晓明

作者个人主页: 姜晓明; 贾全杰; 胡天斗; 黄宇营; 郑文莉; 何伟; 冼鼎昌; 施斌¹; 蒋最敏¹; 王迅¹

## 扩展功能

## 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(981KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert

相关信息

▶ 本刊中 包含 "X射线驻波"的 相 关文章

## ▶本文作者相关文章

- 姜晓明
- 贾全杰
- 胡天斗
- 黄宇营
- 郑文莉
- 何伟
- 冼鼎昌
- 施斌
- 蒋最敏
- 王迅